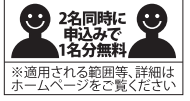


- ★ここ数年で大きくシェアを伸ばしているEUVリソグラフィー！
- ★5nm nodeに向けた課題解決へ！半導体微細加工周辺技術を学ぶ！



【Live配信(リアルタイム配信)】 リソグラフィ/EUVリソグラフィー技術の基礎、 最新技術動向と課題解決策および今後の展望



日時	2021年5月21日(金) 10:30~16:30	会場	Live配信セミナー ※会社・自宅にしながら学習可能です※
受講料	49,500円 ⇒ テレワーク応援キャンペーン 【Live配信/WEBセミナー受講限定】 1名申込みの場合: 受講料 定価: 35,200円 / ※E-Mail案内登録価格 33,440円 ※ E-Mail案内または郵送DM案内の希望を登録の方はE-mail案内登録価格になります。 ※ 同一企業で複数名E-Mail案内登録されている場合は、本割引ではなく「2名同時申込みで1名分無料」割引を適用させていただきます。		資料付

講師 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 所長・教授 渡邊 健夫 氏

趣旨 極端紫外線リソグラフィー(EUVL)技術は30年に開発期間を経て漸く7 nm nodeの半導体デバイスの量産に適用されました。しかしながら、5 nm nodeに向けて多くの課題を抱えています。EUVL技術の黎明期の基礎技術開発を紹介するとともに、最新技術開発の現状、課題への取り組み、並びに今後の半導体微細加工技術の展開についても詳説します。

プログラム	<p>1. はじめに</p> <p>1.1 IoTおよびAIに期待すること</p> <p>1.2 半導体市場</p> <p>1.3 半導体国際ロードマップから読み取れること</p> <p>1.4 半導体微細加工技術の必要性</p> <p>1.5 今後の半導体技術動向と市場との関係</p> <p>1.6 今後の半導体技術に期待すること</p> <p>2. リソグラフィー技術</p> <p>2.1 リソグラフィー技術の変遷</p> <p>2.2 黎明期のX線縮小露光技術からEUVリソグラフィー技術への展開</p> <p>2.3 EUVリソグラフィーとは？ ～EUV光源、光学系、レジスト、マスク、露光機の概要～</p> <p>3. 兵庫県立大学でのEUVリソグラフィー技術開発の取り組み</p> <p>3.1 日本、米国のEUVLプロジェクトの変遷</p>	<p>3.2 ニュースバル放射光施設の紹介</p> <p>4. EUVリソグラフィー技術課題に対する取り組み</p> <p>4.1 レジスト材料プロセス技術</p> <p>4.2 マスク欠陥技術</p> <p>4.3 ペリクル技術</p> <p>4.4 EUV用光源技術</p> <p>5. Beyond EUV(EUVリソグラフィーの短波長化)の可能性</p> <p>6. 日本の半導体技術の過去、現在、今後 ～日本の半導体技術の覇権に重要な要素～</p> <p>7. まとめ</p> <p>□質疑応答□</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。予め「Zoom」のインストールが可能か、接続可能か等をご確認ください。セミナー資料(製本テキスト)はお申し込み時のご住所へ開催日4.5日前に発送させていただきます。詳細はホームページをご確認下さい。

■2名同時申込みで1名分無料■
(1名あたり定価半額の24,750円)

※2名様ともE-Mail案内登録をしていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。 ※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 A210571 (リソグラフィ) お申し込みにはS&T会員の事前登録が必須となります

会社名 団体名		
部署		
役職	〒	
ふりがな	住所	
氏名		
TEL	FAX	
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。	

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

<p>今後のご案内</p> <p><input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み } E-Mail案内登録価格 <input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み } を適用いたします。 <input type="checkbox"/> 希望しない } (E-mailアドレス必須)</p>	
<p>お支払方法</p> <p><input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日)</p>	
<p>通信欄</p>	

●受講料について
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様がご負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
●キャンセル規定
開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。
・開催3~6日前でのキャンセル: 受講料の70%
・開催当日~2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

S&T サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍
サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
https://www.science-t.com